

## 徕卡 DM8000M 显微镜



### 功能/应用

徕卡DM8000 M集成微距模式，可为您提供传统扫描物镜视野的四倍。看到更多意味着更快的吞吐量。新的斜紫外线模式结合斜照明与紫外线，使您能够从任何角度以最高分辨率查看样品 - 并提高检测结果的准确性。应用包括晶圆或材料样品的检查，过程控制和缺陷分析。

### 规格

样品台:可容纳 8 寸晶圆

物镜: 0.7x (MACRO), 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 150x

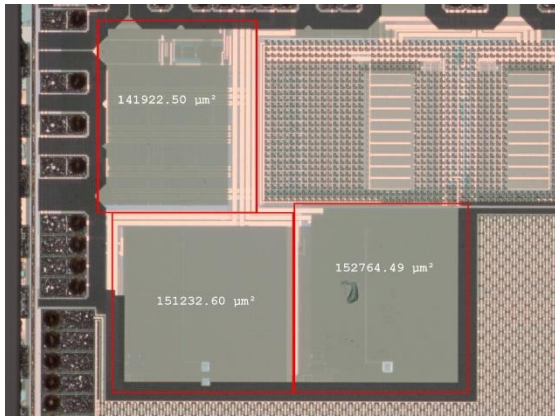
照明: 可见光/紫外光

对比方法: 明场/暗场/衍射干涉对比度

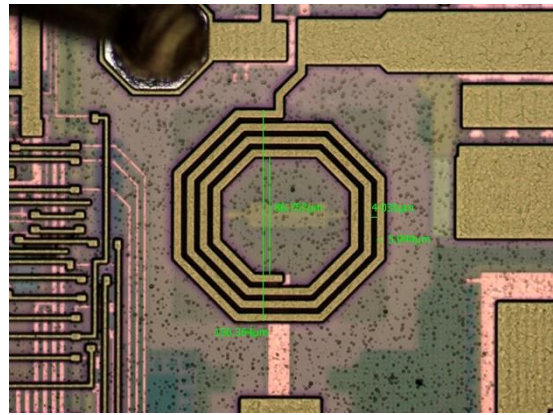
数码相机: DFC295 (三百万像素)

软件: 徕卡 LAS 用于测量及实时 XYZ Builder, 徕卡 MM 用于图像拼图

## 示例应用图片



电路面积测量芯片上组件测量



## 设备制造商网页

<https://www.leica-microsystems.com/products/light-microscopes/p/leica-dm8000-m/>

## Youtube 演示视频

[https://www.youtube.com/watch?v=lvDUz\\_w7mSs&list=PLB04tRIZiriKo2vGuFjdqNh1kAimMPM](https://www.youtube.com/watch?v=lvDUz_w7mSs&list=PLB04tRIZiriKo2vGuFjdqNh1kAimMPM)

Ew